

Programma

Martedì

- 9:00** Registrazione e saluto ai partecipanti
- 10:00** **Struttura e funzionamento del Microscopio Elettronico a Scansione (SEM)**
(A. Tombesi, Centro Interdisciplinare Grandi Strumenti - Modena)
- 11:00** **Elementi di ottica elettronica ed interazione elettrone-materia**
(D. Mirabile Gattia, CR ENEA Casaccia, Roma)
- 12:00** **Rivelatori e segnali nel SEM**
(A. Falqui, Istituto Italiano di Tecnologia - Genova)
- 12:45** Pranzo
- 14:00** **SEM in remoto sul WEB**
(A. Montone, CR ENEA Casaccia, Roma)
- 15:00** **L'infrastruttura ICT dei laboratori virtuali ENEA a supporto della Microscopia**
(S. Migliori, ENEA, Unità Tecnica Sviluppo sistemi per l'informatica e l'ICT)
- 16:00** **I nuovi sistemi per la preparazione di superfici, il taglio e la finitura a fascio ionico**
(P. Brioschi, Microcontrol N.T. SRL)
- 16:20** **SEM a risoluzione subnanometrica e nuove tecniche di imaging** (G. Lamedica, Assing S.p.A)

Mercoledì

- 9:00** **La microanalisi a Raggi X**
(A. Aurora, CR ENEA Casaccia, Roma)
- 10:00** **La preparazione dei campioni per l'osservazione al SEM** (L. Pilloni, CR ENEA Casaccia, Roma)
- 10:45** coffee break
- 11:15** **Requisiti strumentali e operativi per ottimizzare la risoluzione nel SEM**
(M. Vittori Antisari, CR ENEA Casaccia, Roma)
- 12:00** **Photometric Stereo: una via per il 3D al SEM**
(S. Podda, Sardegna ricerche - CRS4 Lab. di Telemicroscopia industriale -Cagliari)
- 12:45** Pranzo
- 14:00** **Esercitazioni pratiche**

Giovedì

- 9:00 - 16:00** **Esercitazioni pratiche**
(F. Pierdominici, L. Pilloni, A. Montone -CR ENEA Casaccia, Roma)

Giovedì 16:00 TEST per CFU



Direzione scientifica:

Amelia Montone
(CR ENEA Casaccia)

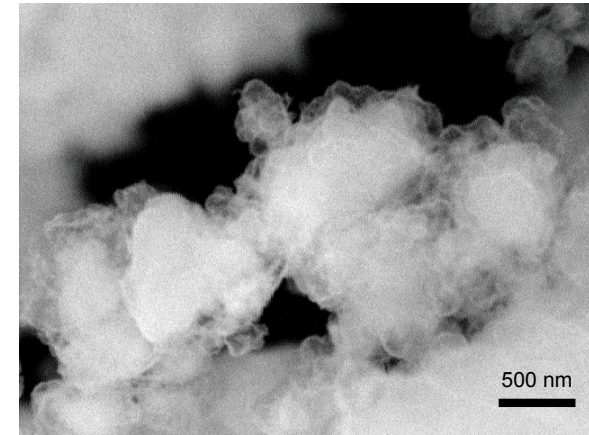
Comitato organizzatore:

**Annalisa Aurora, Patrizia Francesconi,
Juri Rimauro**

Con il supporto di:



S.I.S.M.



Scuola teorico-pratica di Microscopia Elettronica a Scansione in Scienza dei Materiali

Roma, 4 - 6 Ottobre 2011

ENEA
Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma

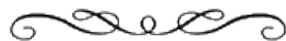
Informazioni Generali

La scuola, organizzata dalla SISM (Società Italiana di Scienze Microscopiche) in collaborazione con l'ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), tratterà i principi della microscopia elettronica a scansione e le sue applicazioni nel campo della Scienza dei Materiali ed è rivolta a ricercatori, studenti e tecnici interessati alla microscopia e a chi opera nel campo dei materiali. La scuola prevede una parte teorica sul SEM (elementi di ottica elettronica, interazione elettrone-materia, rivelatori e segnali, microanalisi); una parte pratica ai microscopi elettronici a scansione (sia a pressione variabile con filamento LaB₆ e microanalisi a raggi X sia FEG ad alta risoluzione). Le principali ditte leader nel settore della microscopia elettronica presenteranno le ultime novità strumentali del settore. I microscopi sono corredati da sistemi di condivisione e controllo remoto per l'acquisizione delle immagini attraverso la rete web. Verrà illustrata la procedura di utilizzo delle apparecchiature in modalità remota da parte di utenti esterni.

È possibile osservare campioni portati dai partecipanti.

La scuola sarà organizzata con lezioni teoriche e pratiche presso i laboratori dell'ENEA C.R. Casaccia per la durata di tre giorni e di una sessione in remoto per l'osservazione dei campioni portati dai partecipanti attraverso la condivisione del microscopio via web.

I partecipanti potranno quindi, nei giorni successivi alla scuola, poter osservare i propri campioni dal proprio laboratorio.



È previsto un test di valutazione finale per gli studenti interessati a richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU).

È previsto un numero massimo di **30 partecipanti**.

È richiesto un numero minimo di **10 partecipanti** per attivare il corso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
dr.^{ssa} Annalisa Aurora annalisa.aurora@enea.it

Iscrizione

La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il **10 settembre 2011** per e-mail (annalisa.aurora@enea.it) o per fax (**06-30483176**), unitamente alla copia del versamento della quota di iscrizione.

Quota di Iscrizione

Socio SISM¹: € 200 + IVA 20%

Non Socio SISM: € 300 + IVA 20%

Per i *non strutturati* (ovvero per assegnisti di ricerca, dottorandi e contrattisti a tempo determinato) è prevista una **riduzione del 20%** sulle quote di iscrizione calcolate al netto dell'IVA.

¹ l'offerta è da considerarsi valida per i soci che hanno effettuato l'iscrizione prima del **1 Luglio 2011**.

A fronte del pagamento sarà rilasciata regolare fattura. Si ricorda che per i dipendenti di Enti Pubblici la quota è esente da IVA (art. 10 DPR 633/72).

Le **quote di iscrizione** comprendono l'accesso ai lavori, il materiale didattico, i coffe break ed i pranzi.

Le quote d'iscrizione possono essere versate attraverso:

1) **Carta di credito** (dal sito www.sism.it)

2) **Bonifico bancario** intestato a S.I.S.M.

IBAN: IT 44 V 01005 38880 0000 00023074

presso BNL-Anguillara Sabazia (ROMA)

Causale: "**Cognome del partecipante + RM1**"

3) **Assegno bancario non trasferibile**

intestato a **S.I.S.M.**, da inviare a:

Dott.ssa **Amelia Montone**,

ENEA, Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali (UTMAT)

C.R. Casaccia, Via Anguillarese, 301, 00123 Roma

Chi farà richiesta di associazione alla SISM sarà esonerato dal versamento della quota associativa per l'anno 2012.

Scheda di partecipazione Scuola Roma 2011

Cognome

Nome:

Qualifica:

Indirizzo:

.....

Tel: Fax:

E-mail:

Socio SISM

Non socio SISM

Strutturato

Non Strutturato

DATI PER FATTURAZIONE (obbligatorio)

(per le fatture emesse a persona fisica è necessario fornire indirizzo di residenza e codice fiscale personale.

per i dipendenti di enti pubblici, al fine di usufruire dell'esenzione IVA, è necessario fornire i dati dell'università e/o dipartimento di afferenza)

INTESTAZIONE

(Ente, Università, Dipartimento o Persona fisica)

.....

.....

INDIRIZZO:

.....

.....

Partita IVA

Codice Fiscale